28. 10. 200

三菱住友シリコン株式会社

PCT/JP2004/016001

出願人又は代理人

出願人(氏名又は名称)

の書類記号

国際出願番号

東田本						
	PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]					
発送日 (日.月.年)	15. 2. 2005					
今後の手続きについては、下記2を参照すること。						
0. 2004	優先日 (日.月.年) 01.12.2003					
01L21/304						
ン株式会社						

#MAKH#A 須田 正義		
あて名	様	
T 170-0013		
東京都豊島区東池袋1丁目11番1号日本生命東池 袋ビル		
		発送日 (日. 月. 年)

ML6318

国際特許分類 (IPC) Int.Cl' H01L21/304, H01L21/308, H01L21/304

国際出願日

(日.月.年)

1.	. この見解書は次の内容を含む。
	レ 第I欄 見解の基礎
	第Ⅱ欄 優先権
	第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
	■ 第IV欄 発明の単一性の欠如
	レ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、 それを裏付けるための文献及び説明
	□ 第VI欄 ある種の引用文献
	第Ⅷ欄 国際出願の不備
	□ 第2個 国際出願に対する意見
	今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。 さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。
3.	さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。
見解	军 書を作成した日

特許庁審査官(権限のある職員)

菅野 智子

電話番号 03-3581-1101 内線

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

27. 01. 2005

名称及びあて先

4 R

9545

3469

	Н)
	スマン	1
(Ĵ	Ì
1	-	ł
	-	_
	\leq	-
Į		>
ı	=	=
ĺ	>	>
ĺ		J
l	Ĺ	_
l	F	
l	C	1
		ׅ֝֞֝֞֝֞֝֞֝֞֝֞֜֝֩֞֝֞֜֞֩֞֞֩֜֞֜֞֞֩֞֜֞֞֩֞֜֞֞
	7	ĺ
l		7

第1個 見解の基礎					
1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。					
この見解費は、 語による翻訳文を基礎として作成した。 それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。					
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。					
a. タイプ					
配列表に関連するテーブル					
b. フォーマット					
コンピュータ読み取り可能な形式					
c. 提出時期 出願時の国際出願に含まれる					
□ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された					
出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された					
3.					
4. 補足意見:					

DEAT AVAIL ADI EL CA

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明						
1. 見解						
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-6				
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 ,	1-6	有 無			
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-6	有			

2. 文献及び説明

文献1: JP 2003-203890 A(三菱住友シリコン株式会社)2003.07.18,全文,全図 (ファミリーなし)

文献 2: JP 11-171693 A(信越半導体株式会社)1999.06.29, 【請求項1】 & US 6099748 A

文献3: JP 60-197367 A(東芝セラミックス株式会社)1985.10.05,全文,全図(ファミリーなし)

文献 4: JP 2003-100701 A(三菱住友シリコン株式会社) 2003. 04. 04, 全文, 全図 (ファミリーなし)

文献 5: JP 07-45564 A(三菱マテリアルシリコン株式会社)1995.02.14,全文,全図 (ファミリーなし)

請求の範囲1, 2, 3, 4に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1, 2, 3, 4により進歩性を有しない。

文献1に記載されたアルカリエッチング液の濃度を文献2に記載された濃度とすること、文献1に記載された裏面軽研磨、表面研磨を文献3に記載された鏡面ウエハの製造方法を用いて行うこと、文献1に記載された酸エッチング、アルカリエッチングを文献4に記載のように複数のエッチング槽を用いて行うことは、当業者にとって容易である。研磨代の具体的な数値の設定を行うことは自明である。

請求の範囲5,6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1,2,3,4,5により進歩性を有しない。

文献 1 に記載された酸エッチングを、文献 4 に記載されたエッチングレートを一定 としたエッチングとすることは当業者にとって容易であり、具体的なエッチング液の混合比については、文献 4 の【第 2 0 段落】【第 2 1 段落】、文献 5 の【請求項 2 】に記載されている。

792" all

スタジンは

起發河